SEP 2 4 70CS SEP 2

PTO/SB/21 (08-00) Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031 U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE aperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. 10/605,252 Applicati n Numb r TRANSMITTAL 09/18/2003 **Filing Date** Tung-Lung Lin **FORM First Named Inventor** (to be used for all correspondence after initial filing) **Group Art Unit Examiner Name** Attorney Docket Number ACMP0032USA Total Number of Pages in This Submission 3 **ENCLOSURES** (check all that apply) After Allowance Communication **Assignment Papers** Fee Transmittal Form to Group (for an Application) **Appeal Communication to Board** Fee Attached Drawing(s) of Appeals and Interferences **Appeal Communication to Group** Licensing-related Papers Amendment / Reply (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) **Petition After Final Proprietary Information** Petition to Convert to a Affidavits/declaration(s) **Provisional Application Status Letter** Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Other Enclosure(s) (please **Extension of Time Request** Address identify below): **Terminal Disclaimer Express Abandonment Request** Request for Refund **Information Disclosure Statement** CD, Number of CD(s) ___ Certified Copy of Priority Document(s) Remarks Response to Missing Parts/ **Incomplete Application Response to Missing Parts** under 37 CFR 1.52 or 1.53 SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT Firm Winston Hsu, Reg. No.: 41,526 Individual name Juston Hay Signature Date **CERTIFICATE OF MAILING** I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date: Typed or printed name Signature **Date**

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

SEP 2 4 2000 SEP 20

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

FOR TRANSMITTAL

Complete if Known

LOCAL SECTION ACT OF 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Complete if Known

FEE TRANSMITTAL for FY 2003

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00

Complete if Known					
Application Number	10/605,252				
Filing Date	9/18/2003				
First Named Inventor	Tung-Lung Lin				
Examiner Name					
Art Unit					
Attorney Docket No.	ACMP0032USA				

METHOD OF PAYMENT (check all that apply) FEE CALCULATION (continued)						
Check Credit card Money Other None 3. ADDITIONAL FEES						
Deposit Account:	<u>Large</u> I					
Deposit FO 0004	Fee Code		Fee Code	Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account SU-USU I Number	1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account North America International Patent Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
Name The Commissioner is sutherized to: (check all that apply)	1053	130	1053	130	Non-English specification	
The Commissioner is authorized to: (check all that apply) Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee		1,840*	1805	1,840*		
to the above-identified deposit account.	1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
FEE CALCULATION	1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
1. BASIC FILING FEE Large Entity Small Entity	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
Code (\$) Code (\$) 1001 750 2001 375 Utility filing fee	1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1002 330 2002 165 Design filing fee	1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
1003 520 2003 260 Plant filing fee	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1004 750 2004 375 Reissue filing fee	1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
		1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1501	1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)	
Extra Claims below Fee Paid	1502	470	2502	235	Design issue fee	
Total Claims20** = X = X = X	1503	630	2503		5 Plant issue fee	<u> </u>
Claims - 3** = X = X = Multiple Dependent	1460	130	1460		Petitions to the Commissioner	
	1807	50	180	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Small Entity Fee Fee	1806	180	1800	-	Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	8021	40	802	1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20	1809	750	280		Filing a submission after final rejection	
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3	4040	700	204	0 075	(37 CFR 1.129(a))	
1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid	1810	750	2810	U 3/5	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims over original patent	1801	750	2801	375	Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other	fee (sp	ecify) _			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Red	uced by	/ Basic	Filing F	Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

SUBMITTED BY			(Complete (if applicable)			
Name (Print/Type) Winston Hsu		11-	Registration No. 41,526 Te		Telephon	9 886289237350
Signature		Willen	11 11	el	Date	9/25/200

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO:** Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

PTO/SB/02B (11-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

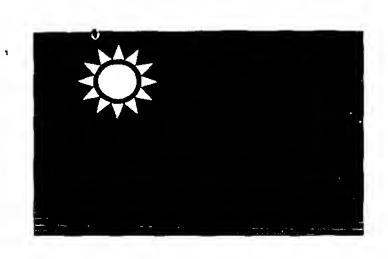
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:				
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy YES	Attached? NO
091121694	Taiwan R.O.C	09/20/2002		~	
·					
		·			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



es es es



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2002 年 09 月 20 日

Application Date

申 請 案 號: 091121694

Application No.

申 請 人:明基電通股份有限公司

Applicant(s)

1

Director General



發文日期: 西元 2002 _年 10 月 25 日

Issue Date

發文字號: 09111020881

Serial No.

申請日期:	案號:	
類別:		

(以上各欄由本局填註)

		發明專利說明書
	中文	利用偵測磁通量校正相位的方法
發明名稱	英 文	METHOD FOR PHASE MATCHING BY DETECTING MAGNETIC FLUX
	姓 名(中文)	1. 林東龍 2. 柳至崇 3. 詹森誌
登明人	姓 名 (英文)	1. Lin, Tung-Lung 2. Liu, Chih-Tsung 3. Chan, Sen-Chih
	國籍	1. 中華民國 2. 中華民國 3. 中華民國
	住、居所	1. 台北縣板橋市文化路一段一0四巷一弄八號 2. 桃園市龍祥街二十四號 3. 桃園縣龜山鄉宏慶街三十一巷二十號二樓
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 明基電通股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1. Benq Corporation
次、三	國 籍	1、中華民國
申請人	住、居所 (事務所)	1. 桃園縣龜山鄉山鶯路157號
	代表人 姓 名 (中文)	1. 李焜耀
•	代表人姓 名(英文)	1. Lee, Kuen-Yao

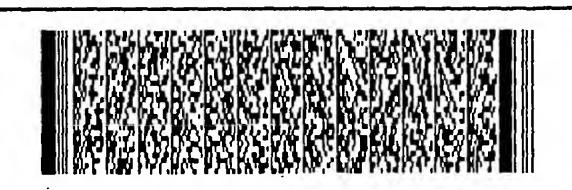
四、中文發明摘要 (發明之名稱:利用偵測磁通量校正相位的方法)

本發明係提供一種校正相位的方法,其係利用偵測磁通量來校正一第一元件及一第二元件之相對應相位,其提供一磁通產生裝置,用來提供磁通,另提供一磁感測裝置,用來感應磁通量,並依據該磁感測裝置偵測該磁產生裝置之磁通量來相對應地調整該第一元件及該第二元件之相位相吻合。

英文發明摘要 (發明之名稱:METHOD FOR PHASE MATCHING BY DETECTING MAGNETIC FLUX)

A method used for phase matching. It matches the relative phase of a first element and a second element by detecting magnetic flux. It provides a agnetic flux generating device in order to generate magnetic flux. It also provides a magnetic sensing device in order to induce the magnetic flux. According to the magnetic flux detected by the magnetic sensing device it adjusts the relative position between the first element and the second element until the magnetic flux





四、中文發明摘要 (發明之名稱:利用偵測磁通量校正相位的方法)

英文發明摘要 (發明之名稱:METHOD FOR PHASE MATCHING BY DETECTING MAGNETIC FLUX)

reaches a predetermined value, which means the phase of the first element and it of the second element are matched.



本案已向			. 45 1% il. 14b	
國(地區)申請專利	申請日期	案號	主張優先權	
		無		
••				
			•	
•				
有關微生物已寄存於		寄存日期	寄存號碼	
有關假生物也可行外				
		<i>!</i> :		
		無	•	
•		·-		
				•

五、發明說明 (1)

發明之領域

本發明提供一種校正相位之方法,尤指一種利用偵測磁通量(Magnetic Flux)校正一第一元件與一第二元件之相對應相位之方法。

背景說明

於工業設計中,有許多的電子產品或機械產品其中包 含有部份装置或元件需要因應該產品各種不同之狀況及應 進行細微調整 (Fine Tuning) 以達到該產品使用上的 最佳效能。於此種細微調整的實際應用中,螺絲(Screw 時常被選為其最佳之媒介,這是由於螺絲具有構造簡 成本低廉的優勢,最重要的,螺絲係具有將沿著其本 體一垂直軸作旋轉的相位(Phase)改變量,轉換為其沿 該軸方向相對應於其螺絲孔所在之物體的位移量之特性, 而根據一螺絲之螺紋間距大小,該相位改變量對應於該位 移量之比值可以被設計為一非常大之值,亦即當該螺絲沿 一垂直軸作一相當大之相位改變時, 來說十分小之沿該軸方向的位移量。如果將該相位 變量用為細微調整中之調整機制(例如用一螺絲起子旋 ,而將該位移量經由機械式或電子式的設計關 需要接受調整之裝置或元件的狀態改變 如一機械橫桿之垂直平移量,或一可變電阻之電阻值等



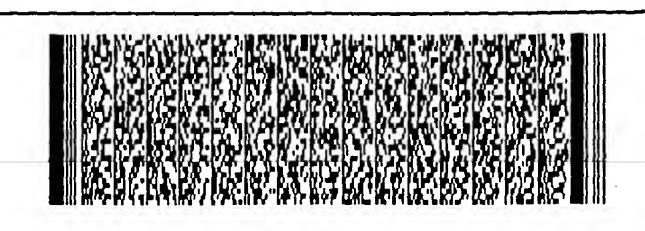


五、發明說明 (2)

),則如此之設計將可完成一非常精準之細微調整動作。 綜上所述螺絲之特性,其實為進行細微調整時之一有利工具。

由於一螺絲與用來旋轉該螺絲之螺絲起子(Screw Driver)之間,通常係利用該螺絲上之一螺絲針穴之幾何 形狀與該螺絲起子頂端(Screw Bit)之幾何形狀能夠相 使該螺絲接收該螺絲起子對其於沿軸旋轉方向上 之施力以達到其相位之改變。然而一般螺絲之螺絲針穴的 設計(最常見者即一字形或十字形),會造成該螺絲起子 ~ 與該螺絲完全齒合並實際開始對該螺絲施力、順利改變 其相位之前,必須先旋轉一角度以使其頂端及該螺絲之螺 絲針穴之間之相對位置到達能夠完全齒合的地步,但是因 為每一次進行齒合之前該螺絲及該螺絲起子之間的相對位 置均不相同,故該角度係為一不可預測之值。此一現象對 於利用一自動控制程式對一螺絲進行細微調整的生產線來 說造成很大的不便,因為當一生產流程中預定對一裝置進 行一特定程度之細微調整時,其係利用一螺絲起子對相對 應於該裝置之一螺絲施以一特定的相位改變量 該角度之不可預測性則將成為此一細微調整程序中的誤差 素,該自動控制程式將無從判斷該角度誤差值進而於該 螺絲起子之旋轉量上予以補償,而導致該自動控制程式預 期對該裝置達到該特定程度之細微調整,實際上卻仍存有 誤差,而此誤差對於細微調整來說,通常是不可接受的。





五、發明說明 (3)

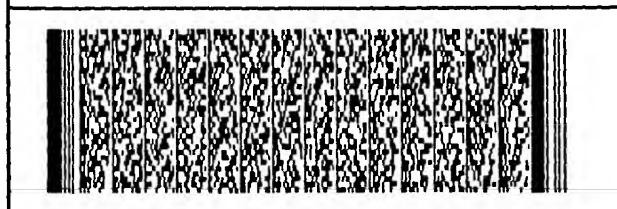
為了克服此現象所造成的細微調整誤差,習知技術通常使用具有更多道齒紋之螺絲針穴的螺絲(例如六道齒紋或者以上)來減少該不可預測之角度值以達到減低該項誤差因素,或者使用一具有複雜構造之螺絲針穴的螺絲及其相對應的螺絲起子之設計,利用機械式的齒合過程以確保當螺絲起子開始轉動時即可施力於該螺絲上。

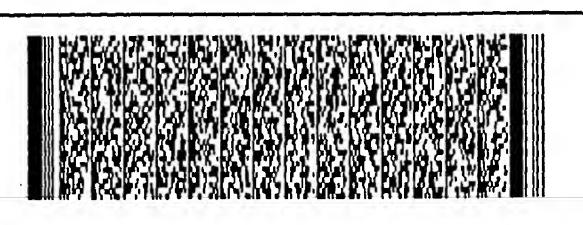
然而前述習知技術之多齒紋螺絲或特殊構造螺絲由於並非一般容易取得之製品,必須另闢生產線訂製,而且其製程較一般構造簡單之螺絲為複雜,將造成使用者可觀的人本增加,而該多齒紋螺絲甚至無法將該誤差完全消除,只能減少其影響至可容忍的範圍,實非用於大量生產之生產線中十分理想的細微調整工具。

發明概述

本發明之主要目的在於提供一種利用於不同空間幾何相對位置下造成不同之磁通路徑,而偵測到不同之磁通量以校正一第一元件與一第二元件之相對應相位的方法,以解決上述習知技術之多齒紋螺絲或特殊構造螺絲成本過高問題。

根據本發明之申請專利範圍,係揭露一種利用偵測磁通量來校正一第一元件與一第二元件之相對應相位之方





五、發明說明(4)

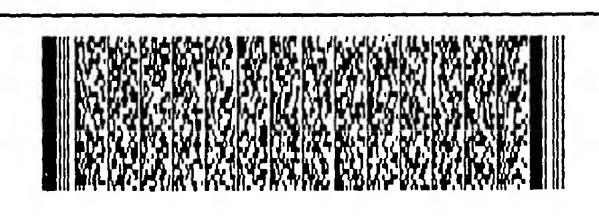
法,其先提供一磁通產生裝置,用來提供磁通,並提供一磁感測裝置,用來感應磁通量,再依據該磁感測裝置偵測該磁通產生裝置之磁通量,沿一垂直軸轉動該第一元件直到磁通量到達一預定值以使該第一元件與該第二元件之相位相吻合。

本發明係利用磁通產生裝置及磁感測裝置成本低廉之優勢,以及磁場可穿透大多數材料而被感測之便利性,而提供一種可消除前述之該不可預測之角度所造成的細微調整之誤差因素的方法。

發明之詳細說明

請參照圖一,圖一所示為本發明所揭露之一校正相位之方法的言圖。其係為校正一第一元件 14與一第二元件 16之相對應相位的方法,其於第一元件 14及第二元件 16所在之背景空間中利用一磁通產生裝置 10提供一磁場 10 a,則於該背景空間中之任何一點將由於該背景空間中之任何一點將 10 a之存在而產生一相對應之磁通量所處之該點的碰通量,此時沿極感測裝置 12所處應其所處之該轉該第一元件 14與第二元件 16之報位是否吻合。該校正相位之方法的詳細操作步驟如下。

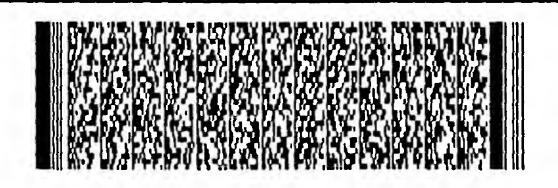




五、發明說明 (5)

請參照圖一及圖二,圖一中有一第一元件 14以及一第一元件 16,該校正相位之方法係欲沿著一五件 16之間相位之方向及策轉之方向校正第一元件 14及第二元件 16之間相對應的位置及相位是否達到該特定位置,為判斷第一元件 14及第二元件 16之間相對應的位置及相位是否達到該特定位置,其係垂直熱 18的平移改變量及方向,而其沿著垂直軸 18的平移改變量及方向。另外定義一第二校正線 16a,其係垂直於垂直軸 18的相位改變量及方向。另外著垂直軸 18的平移改變量及方向。另外若垂直軸 18的平移改變量及方向,而其沿著垂直軸 18的相位改變量及方向係相等於第二元件 16沿著垂直軸 18的相位改變量及方向。

接下來依據垂直於垂直軸 18之第一校正線 14a以及第二校正線 16a, 定義一距離 18a, 其係為自第一校正線 14a沿著垂直軸 18之方向至第二校正線 16a之間的距離,同時定義當距離為一預定值時,則第一元件 14及第二元件 16之間相對的位置已達到該特定位置。另定義一相位角 18b, 係為自第一校正線 14a沿著垂直軸 18之順時針方向至第二校正線 16a之間的角度,同時並定義當相位角 18b為零時,則第一元件 14及第二元件 16之間相對的相位已達到該特定位置,亦即第一元件 14與第二元件 16之相位相吻合。



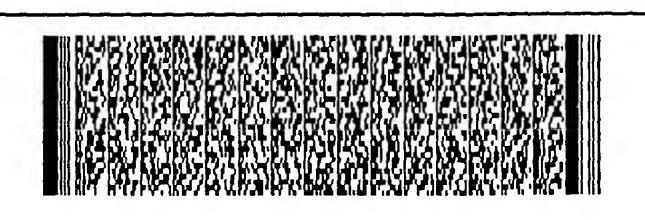


五、發明說明 (6)

為了達到位置及相位校正的目的,於第一元件 14及第二元件 16所在之背景空間中放置一磁通產生裝置 10將提供一磁場 10a,如此則於該背景空間中之任何一點將由於磁場 10a之存在而產生一相對應之磁通量值。又另外於該背景空間中之一處放置一一磁感測裝置 12,其係用來感應其所處之該點的磁通量。由於第一元件 14及第二元件 16之組成結構、幾何形狀以及所使用的材料會因不同的應用而有所差異,則當其二者之間沿著會影響 18相對應之中任何一點由於協場 10a之存在而產生之該磁通量的大小。基於中任何一點由於場別可利用磁感測裝置 12感應其所處之時,則可利用磁感测裝置 12感應其所處之時,則可利用磁感测裝置 12感應其所處之間相對應與數,則可利用磁感测裝置 12感應其所處之間相對應與數,則可利用磁感测裝置 12点應其所處之間相對應與數,則可利用磁点测裝置 12点應其所處之間相對應與數,則可利用磁点测裝置 12点應其所處之間相對應與數,則可利用磁点测裝 12点應其所處之間相對應相位之相位角 18b的變化的關係,來作為判斷第一元件 14與第二元件 16之相位是否相吻合的依據。

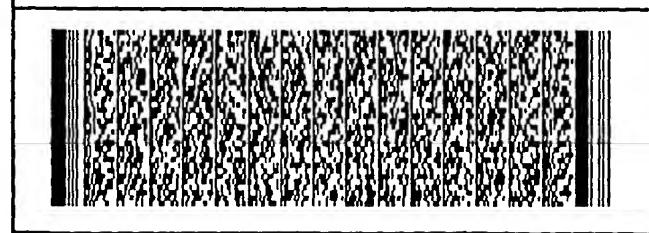
如圖二中為一上述該磁通量對應於距離 18a及相位角 18b合併效應之關係圖的一範例,其中當該二元件間之距離為該預定值且該相位為 0度(亦即 360度)的時候,該磁量達到一最大值(如圖二中之 X點),故若磁感測裝置 12所感應到之磁通量為該最大值時,即可判斷第一元件 14 與第二元件 16已到達該特定位置且相位相吻合。關於磁通產生裝置 10及磁感測裝置 12之位置,可根據於何種設計之

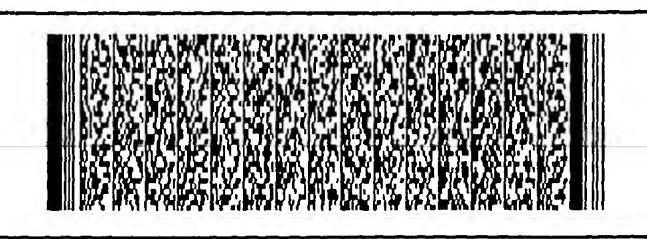




五、發明說明 (7)

請參照圖三至圖八,圖三中所示為圖一中該校正相位之方法的一實施例,其中於一金屬框架 30上有需要細微調整之一裝置 32, 其細微調整的方法係利用二連動橫桿 34以機械式之方式連接於裝置 32之調整機制上,再利用三螺絲方向的位移量來造成二連動橫桿 34之細微平移量,而達到對裝置 32之細微調整的目的。其另外包含有一磁鐵 20, 其係用來產生一磁場;以及三螺絲起子 24, 用來旋轉以對螺

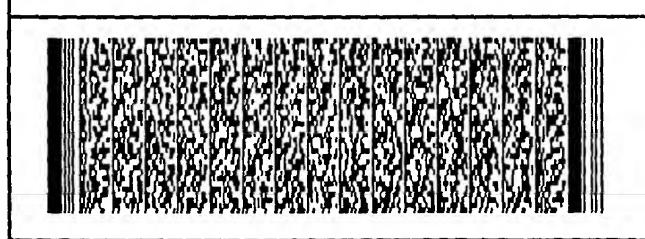


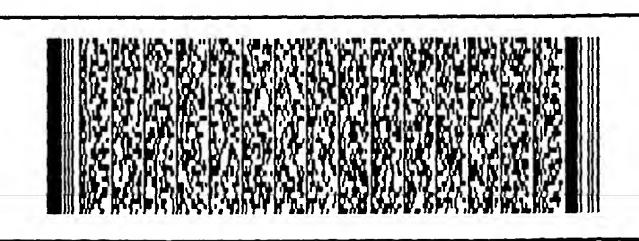


五、發明說明 (8)

絲 26施力。圖四中係為圖三中螺絲起子 24之內部構造的示 包'含有一螺絲起子頂端 24a,用來直接對螺絲 26 一霍爾元件 22, 連接於螺絲起子頂端 24a之末端, 用來將一經由輸入端 40a及 40b輸入之電壓,藉由對該處之 磁通量的感應,轉換成一經由輸出端 42a及 42b輸出之電 壓;四電樞(Armature)36,分別電連接於輸入端40a、 40b及輸出端 42a、 42b, 配合四電刷(Brush) 38之使用以 確保當螺絲起子24在轉動的時候,電壓訊號之輸入及輸出 而於圖五中則為圖四 中霍爾元件 22的平面示意 霍爾元件 22之輸出端 42a、 42b輸出之該電壓值 圖六所示之一放大電路44放大,以利於生產線 制程式的判斷。本實施例中之霍爾元件 24所 輸 壓訊號經由放大電路 44放大後可表示為一電 應於霍爾元件24所感應的磁通量之關係圖50,其中 線 52所表示之該關係可看出,當該磁通量增加時,該電壓 值會隨之增加,直到其達到一飽和值為止。

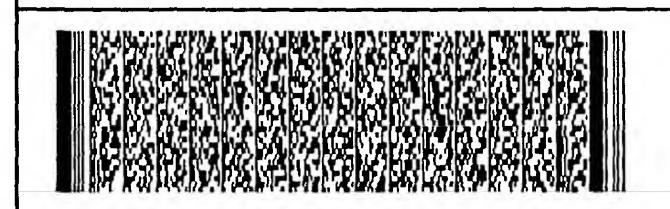
請參照圖七及圖八,請注意,為了得到較明顯之磁通量變化,螺絲 26以及螺絲起子頂端 24a係選用磁導係數較高的金屬材料(如鐵、鎮等),圖七為圖三中螺絲 26及螺 起子頂端 24a未齒合時之示意圖,當螺絲 26及螺絲起子頂端 24a處於未齒合之狀態時,由於螺絲起子頂端 24a除了少部份面積與螺絲 26之螺絲針穴較為接近之外,其他部分均離該螺絲針穴較遠,則造成位於螺絲 26及螺絲起子頂端





五、發明說明 (9)

24a之間的空氣部份較多,也就是說,當磁通通過螺絲26 而到達螺絲,起子頂端 24a時,其間路徑將經過較多之空氣 部份;而於圖八中為圖三中螺絲26及螺絲起子頂端24a齒 合時之示意 圖 ,當螺絲 26及螺絲起子頂端 24a處於齒合之 狀態時,由於其二者為完全密合,則其間的空氣部份非常 ,也就是說,當磁通通過螺絲26而到達螺絲起子頂端 24a時,其間路徑將經過較少之空氣部份。而由於螺絲 26 及螺絲起子頂端 24a之材料係選用磁導係數較高的金屬材 其磁導係數會高出空氣許多,故當一磁通之路徑中有 較多之空氣部份時,其磁通量將相對地為較小,而當一磁 中有較少之空氣部份時,其磁通量將相對地為較 大,所以從螺絲 26及螺絲 起子頂端 24a未齒合之狀態起, 轉動螺絲起子24至到進入螺絲26及螺絲起子頂端24a齒合 為止的過程中,通過其二者之磁通量將由小逐漸變 爾元件 22經由感應該磁通量而產生的該電壓訊號 50中之曲線52一般,進入一飽和值 圖 適當設計該自動控制程式,提供一電壓的臨界值54,使其 接近並略小於該電壓飽和值,則當霍爾元件22經由感應該 而產生的該電壓訊號到達臨界值 54時,該自動 断螺絲 26及螺絲起子頂端 24a已經進入齒合之 並且可以開始對螺絲26進行實際之細微調整的動 。以上所述乃本發明之較佳實施例,其他利用相同之概 之不同應用亦為本發明之所涵蓋範圍

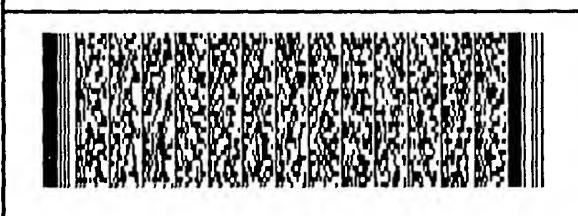




五、發明說明 (10)

相較於習知技術利用多齒紋螺絲或特殊構造螺絲來達到於進行細微調整之動作前確保螺絲起子頂端及螺絲針穴之相位相吻合以消除細微調整之誤差的目的,本發明具有相對來說成本低廉的優勢。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖示之簡單說明

圖一為本發明之校正相位之方法的示意圖。

圖二為圖一中之二元件的相對應距離及相位與該磁感測裝量所感應的磁通量之相對關係的示意圖。

圖三為圖一中之校正相位之方法應用於螺絲及螺絲起子相位校正的示意圖。

圖四為圖三中之螺絲起子之內部構造的示意圖。

圖五為圖四中之霍爾元件的示意圖。

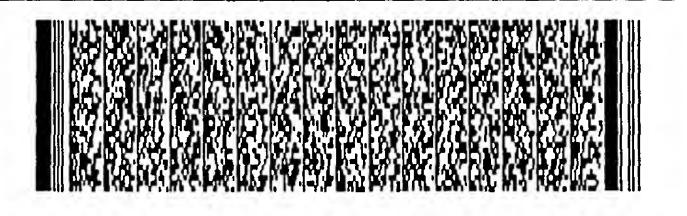
圖六為用來將圖四中之霍爾元件之電壓訊號放大的放電路之功能方塊圖。

圖七為圖三中之螺絲及螺絲起子頂端未齒合時之示意圖。

圖八為圖三中之螺絲及螺絲起子頂端齒合時之示意圖。

圖示之符號說明

10	磁通產生裝置	1 U a	磁場
1 2	磁感測裝置	14	第一元件
14a	第一校正線	1 6	第二元件
16a	第二校正線	18	垂直軸
18a	距離	18b	相位角
2 N	玩。 盆	22	霍 爾 元 件



圖式簡單	足說明							,	
2	2.4	螺絲起子	24a	螺	絲	起	子	頂	端
· 2	26	螺 絲	3 0	金	屬	框	架		
3	3 2	裝 置	3 4	連	動	横	桿		
3	3 6	電樞	38	電	刷				
4	10a · 40b	輸入端	42a · 42b	輸	出	端			

54

關係圖

臨界值

44

52

放大電路

曲線

六、申請專利範圍

1. 一種利用偵測磁通量(Magnetic Flux)校正一第一元件與一第一元件之相對應相位之方法,其包含:

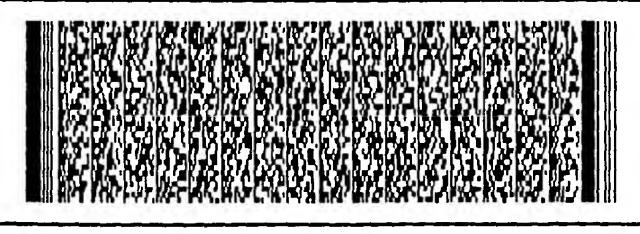
相對應的設置該第一元件與該第二元件;

提供一磁通產生裝置,用來提供磁通於該第一元件與該第二元件間;

提供一磁感測裝置,用來感應該第一元件與該第二元件間之磁通量;

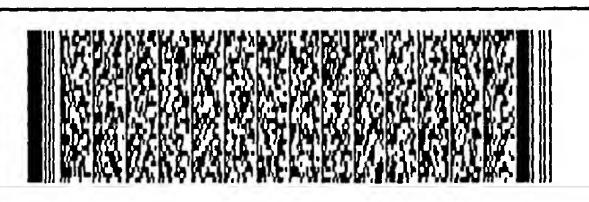
相對應的調整該第一元件與該第二元件,使得該磁感測裝置偵測之磁通量達一預定值。

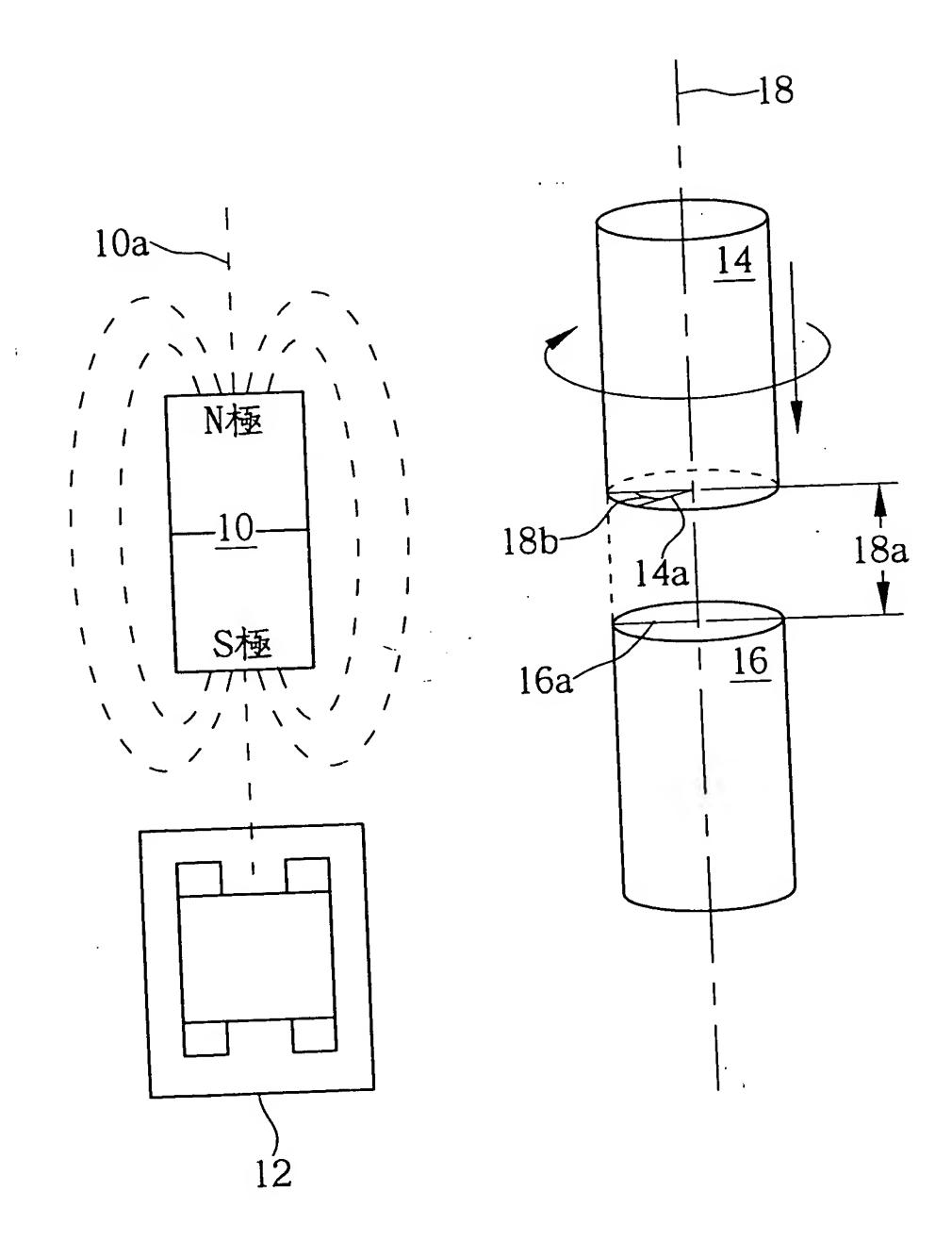
- 型. 如專利申請範圍第1項所述之方法,其中該磁通產生裝置為一磁鐵。
- 3. 如專利申請範圍第1項所述之方法,其中該磁感測裝置為一霍爾元件(Hall Element),其會將磁通量轉換為相對應之電壓訊號。
- 4. 如專利申請範圍第3項所述之方法,其另包含有提供一放大電路,用來將輸出自該霍爾元件的電壓訊號放大以利於進行判斷。
- 5. 如專利申請範圍第1項所述之方法,其中該磁感測裝置為一磁阻元件(MR Device),其會依磁通量之大小而改變其電阻值。



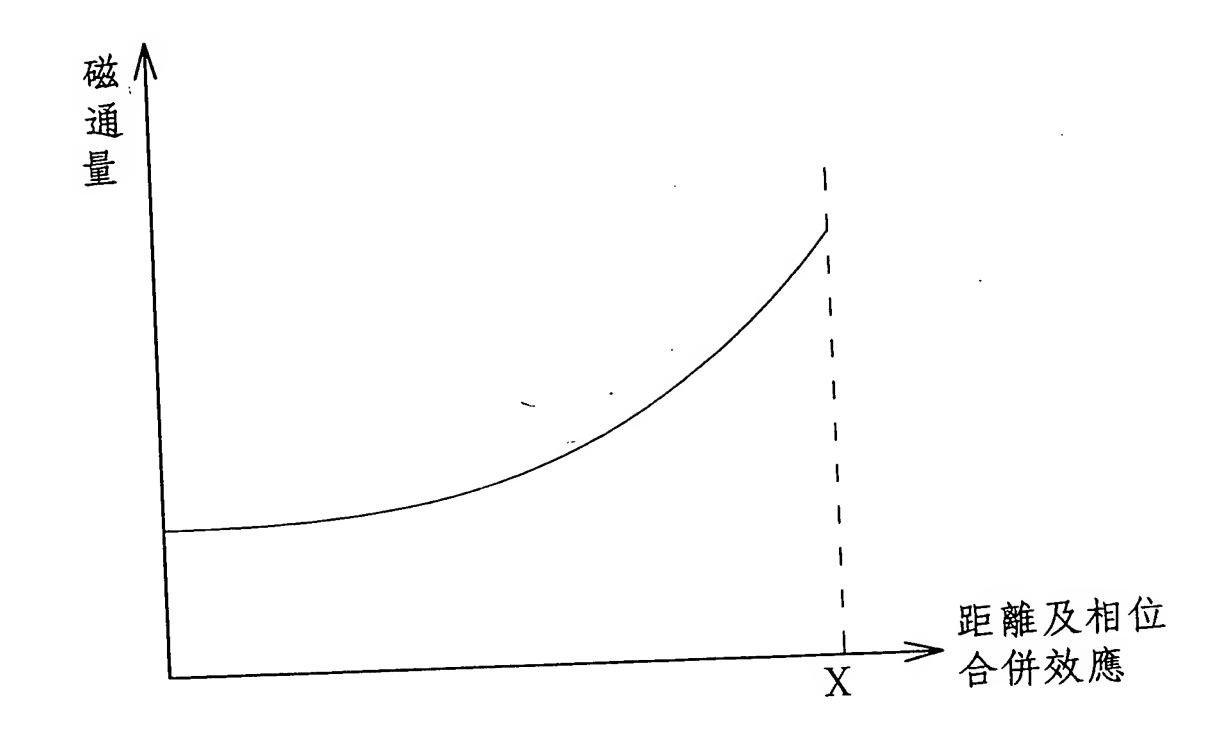
六、申請專利範圍

- 6. 如專利申請範圍第1項所述之方法,其中該磁感測裝置為一磁二極體 (Magnetic Diode),其會依磁通量之大小而改變其通過之電流值。
- 7. 如專利申請範圍第1項所述之方法,其中該第一元件係一螺絲起子(Screw Driver),該第二元件係一螺絲。
- 8. 如專利申請範圍第7項所述之方法,其中該螺絲係安裝於一金屬板上。
- 9. 如專利申請範圍第8項所述之方法,其中該磁通產生裝置係設於該金屬板上,該磁感測裝置係設於該螺絲起子之一端。
- 10. 如專利申請範圍第1項所述之方法,其中該磁通產生裝置係設於該第二元件之一端,該磁感測裝置係設於該第一元件之一端。
- 11. 如專利申請範圍第1項所述之方法,其中該磁通產生置係設於該第一元件之一端,該磁感測裝置係設於該第二元件之一端。

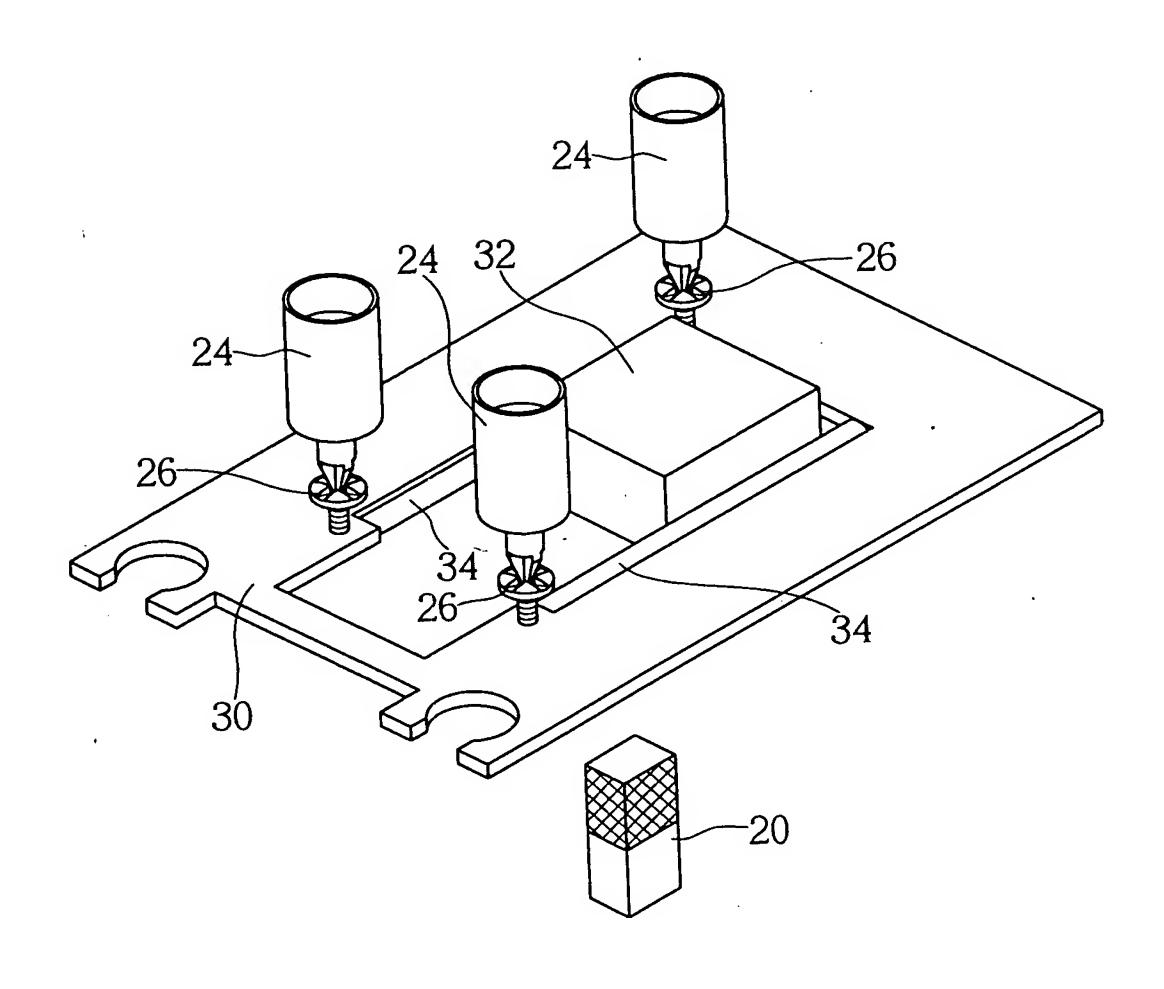




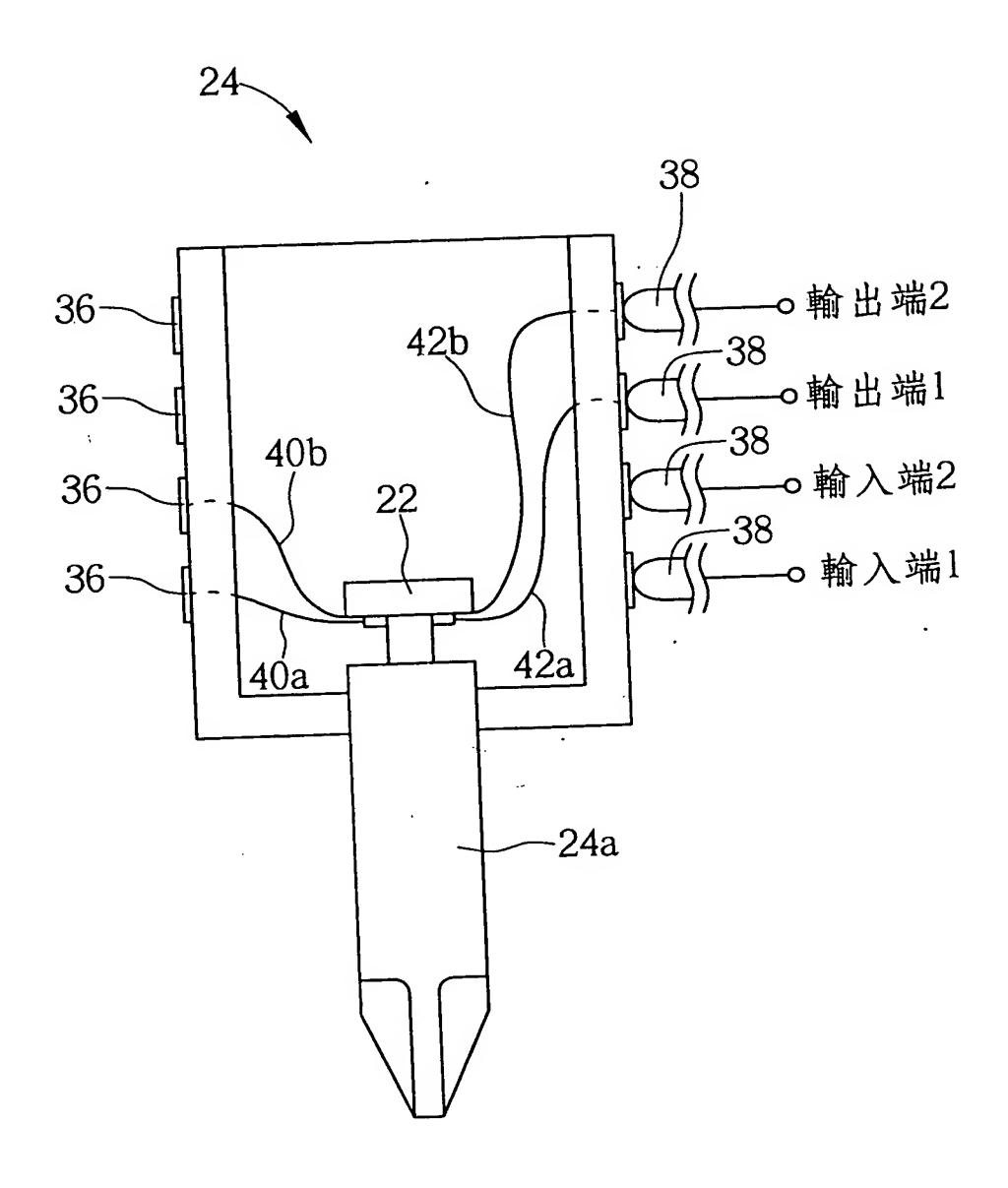
圖一



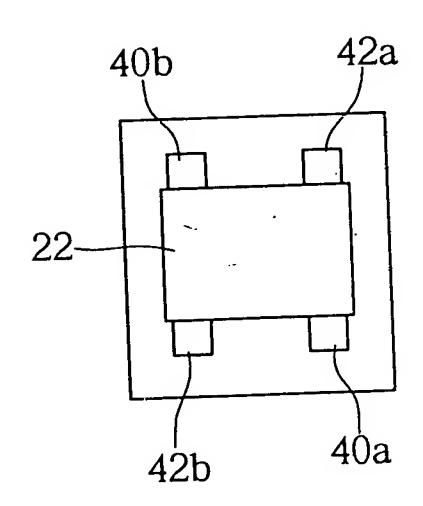
圖二



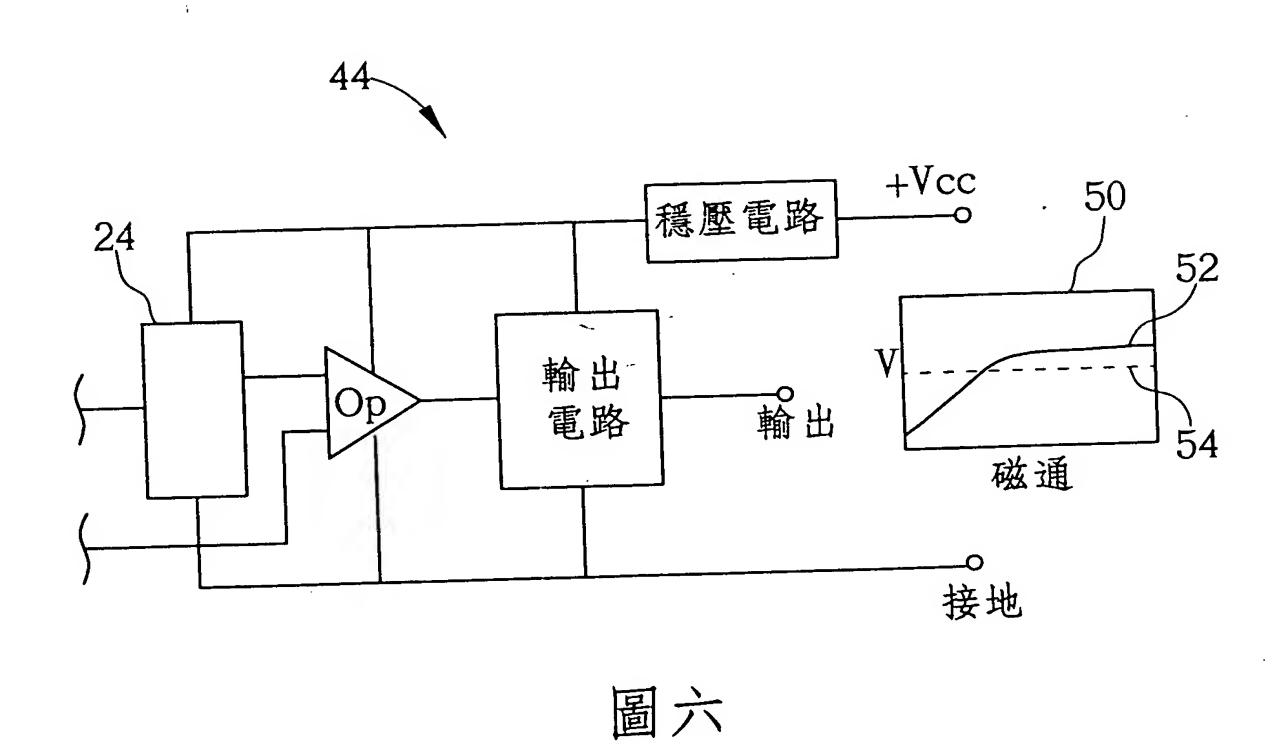
圖三



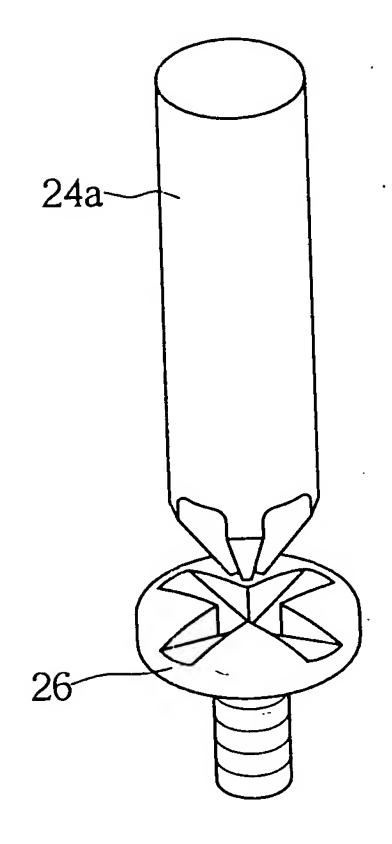
圖四



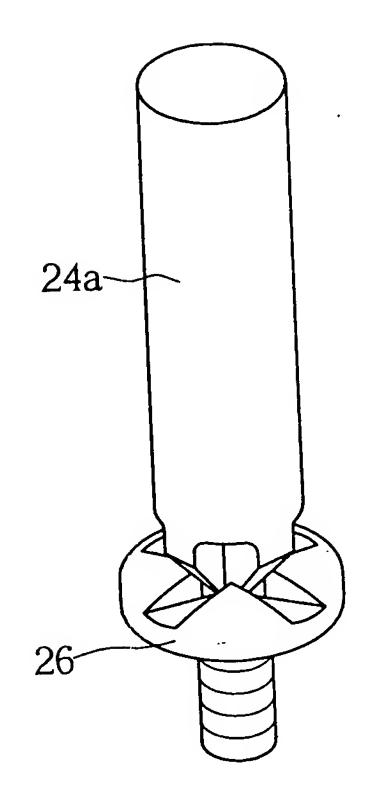
圖五



(:...



圖七



圖八

